



Profilometer (Weißlichtinterferometer)

Messgrößen

- Dreidimensionale Vermessung von Oberflächen

Prinzip

- Typ: Veeco NT9100, VSI (Vertical Scanning Interferometry) und PSI (Phase Shifting Interferometry)
- Objektive: 2.5X, 10X und 50X, automatisierter Objektivrevolver
- „Stitching“ für Vermessung großer, zusammenhängender Flächen in x,y-Richtung
- Verfahrweg: z: 100 mm, x,y: 150 mm
- Scan-Bereich z: 0.1 nm bis 10 mm

Anwendung

Berührungslose dreidimensionale Vermessung von rauen bis sehr glatten Oberflächen, Bestimmung abgeleiteter Größen wie Rauigkeit, Ebenheit oder Volumen

Literatur / Referenzen

- Infobroschüre: [http://www.veeco.com/pdfs/brochures/B506-Rev_A7-Wyko_NT_Series_Optical_Profilers-Brochure_\(HiRes\).pdf](http://www.veeco.com/pdfs/brochures/B506-Rev_A7-Wyko_NT_Series_Optical_Profilers-Brochure_(HiRes).pdf)
- Weitere Infos: <http://www.veeco.com/pdfs/webinar-slides/A-First-Look-at-NT9080-webinar-slides-100408.pdf>

Kontakt

- Stephanie Karg, DLR-Institut für Technische Physik, Tel: +49 711 6862 596
- Dr. phil. nat. Dorothee Maria Rück, Technologiemarketing

Dieses Handout sowie Querverweise zu verwandten Messtechniken und Anlagen finden Sie unter: <http://messtec.dlr.de/link-564-de>.